真空分野のISO規格とJIS一覧（2025年7月2日現在）

(a) 用語・図記号

ISO規格番号	ISO規格名	対応JIS規格番号	JIS規格名（JISがないものについてはISO規格名の仮訳）
ISO 3529-1:2019	Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 1: General terms	JIS Z 8126-1:2022	真空技術—用語—第1部：一般用語
ISO 3529-2:2020	Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 2: Vacuum pumps and related terms	JIS Z 8126-2:2023	真空技術—用語—第2部：真空ポンプ及び関連用語
ISO 3529-3:2014	Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 3: Total and partial pressure vacuum gauges	JIS Z 8126-3:2018	真空技術—用語—第3部：真空計及び関連用語
ISO 14617-1:2025	Graphical symbols for diagrams -- Part 1: General rules	JIS Z 8617-1-15 : 2008-2009	ダイアグラム用図記号シリーズ
ISO 14617-2:2025	Graphical symbols for diagrams -- Part 2: Graphical symbols	JIS Z 8617-5,8,9,12 : 2023	ダイアグラム用図記号シリーズ（追補）
—	—	JIS Z 8207:1999	真空装置用図記号

(b) 真空ポンプ関連 (WG1)

ISO規格番号	ISO規格名	対応JIS規格番号	JIS規格名（JISがないものについてはISO規格名の仮訳）
ISO 1608-1:1993	Vapour vacuum pumps -- Measurement of performance characteristics -- Part 1: Measurement of volume rate of flow (pumping speed)	JIS B 8317-1:1999	蒸気噴射真空ポンプ—性能試験方法—第1部：体積流量（排気速度）の測定
ISO 1608-2:1989	Vapour vacuum pumps -- Measurement of performance characteristics -- Part 2: Measurement of critical backing pressure	JIS B 8317-2:1999	蒸気噴射真空ポンプ—性能試験方法—第2部：臨界背圧の測定
ISO 21360-1:2020	Vacuum technology -- Standard methods for measuring vacuum-pump performance -- Part 1: General description	JIS B 8329-1:2015	真空技術—真空ポンプの性能試験方法—第1部：共通試験方法
ISO 21360-2:2020	Vacuum technology -- Standard methods for measuring vacuum-pump performance -- Part 2: Positive displacement vacuum pumps	JIS B 8329-2:2015	真空技術—真空ポンプの性能試験方法—第2部：容積移送式真空ポンプの試験方法
ISO 21360-3:2019	Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum pump performance — Part 3: Specific parameters for mechanical booster vacuum pumps	—	(メカニカルブースターポンプの性能試験方法)
ISO 21360-4:2018	Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum-pump performance — Part 4: Turbomolecular vacuum pumps	JIS B 8328:2009	真空技術—ターボ分子ポンプの性能試験方法
ISO 21360-5:2023	Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum-pump performance — Part 5: NEG vacuum pumps	—	(NEGポンプの性能試験方法)
ISO 21360-6:2023	Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum-pump performance — Part 6: Cryo vacuum pumps	—	(クライオポンプの性能試験方法)
ISO 27892:2010	Vacuum technology -- Turbomolecular pumps -- Measurement of rapid shutdown torque	—	(ターボ分子ポンプの急停止トルクの測定方法)

(c) 真空計測関連 (WG2)

ISO規格番号	ISO規格名	対応JIS規格番号	JIS規格名（JISがないものについてはISO規格名の仮訳）
ISO 3529-3:2014	Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 3: Total and partial pressure vacuum gauges	JIS Z 8126-3:2018	真空技術—用語—第3部：真空計及び関連用語
ISO 3567:2011	Vacuum gauges -- Calibration by direct comparison with a reference gauge	JIS Z 8750:2009	真空計校正方法
ISO 14291:2012	Vacuum gauges -- Definitions and specifications for quadrupole mass spectrometers	—	(四重極質量分析計の仕様の表記法)
ISO 19685:2017	Vacuum technology — Vacuum gauges — Specifications, calibration and measurement uncertainties for Pirani gauges	—	(ピラニ真空計の仕様の表記法、校正方法、及び測定不確かさの評価方法)
ISO 20146:2019	Vacuum technology — Vacuum gauges — Specifications, calibration and measurement uncertainties for capacitance diaphragm gauges	—	(隔膜真空計の仕様の表記法、校正方法、及び測定不確かさの評価方法)
ISO 27893:2011	Vacuum technology -- Vacuum gauges -- Evaluation of the uncertainties of results of calibrations by direct comparison with a reference gauge	—	(真空計の比較校正における不確かさの評価方法)
ISO 27894:2009	Vacuum technology -- Vacuum gauges -- Specifications for hot cathode ionization gauges	JIS Z 8129:2014	真空技術—真空計—熱陰極電離真空計の仕様の表記法
ISO 24477:2025	Vacuum technology — Vacuum gauges — Specifications, calibration and measurement uncertainties for spinning rotor gauges	—	(スピニングロータ真空計の仕様の表記法、校正方法、及び測定不確かさの評価方法)
ISO/TS 6737	Vacuum technology — Vacuum gauges — Characteristics for a stable ionisation vacuum gauge	—	(高安定電離真空計の特性)
ISO/TS 20175:2018	Vacuum technology — Vacuum gauges — Characterization of quadrupole mass spectrometers for partial pressure measurement	—	(四重極質量分析計の特性評価方法)
ISO/TS 20177:2018	Vacuum technology — Vacuum gauges — Procedures to measure and report outgassing rates	—	(ガス放出率の測定方法)
		JIS Z 8751 :1994	液柱差を使う真空計による真空度測定方法
		JIS Z 8752 :1989	熱陰極及び冷陰極電離真空計による圧力測定方法
		JIS Z 8753 :1989	熱伝導真空計による圧力測定方法

(d) 真空コンポーネント関連 (WG3)

ISO規格番号	ISO規格名	対応JIS規格番号	JIS規格名（JISがないものについてはISO規格名の仮訳）
ISO 1609:2020	Vacuum technology -- Dimensions of non-knife edge flanges	JIS B 2290:2024	真空技術—非ナイフエッジフランジの形状及び寸法
ISO 2861:2020	Vacuum technology -- Dimensions of clamped-type quick-release couplings	JIS B 8365:2024	真空技術—クランプ型クイックカップリングの形状及び寸法
ISO 3669:2020	Vacuum technology --Dimensions of knife-edge flanges	JIS B 2294:2022	真空技術—ナイフエッジフランジの形状及び寸法
ISO 9803-1:2020	Vacuum technology -- Mounting dimensions of pipeline fittings -- Part 1: Non knife-edge flange type	JIS B 2293:2000	真空配管継手の取付け寸法—第1部：非ナイフエッジフランジ
ISO 9803-2:2020	Vacuum technology -- Mounting dimensions of pipeline fittings -- Part 2: Knife-edge flange type	—	(真空配管継手の取付け寸法—第2部：ナイフエッジフランジ)
ISO 21358:2020	Vacuum technology -- Right-angle valve -- Dimensions and interfaces for pneumatic actuator	—	(L形バルブ—圧空バルブの形状とインターフェイス)
ISO 27895:2009	Vacuum technology -- Valves -- Leak test	—	(バルブのリークテスト)

非ナイフエッジフランジは、通称ISOフランジ、ナイフエッジフランジは、通称ICFフランジまたはCFフランジと呼ばれる。
クランプ形クイックカップリングは、KFフランジ、またはNWフランジとも呼ばれる。